

Реферат

Пояснювальна записка до дипломної роботи містить 72 сторінки, 26 рисунків, 44 бібліографічних найменувань.

В даній роботі розглядається нанесення ІТО плівок методом магнетронного напилення. Також розглянуті та проаналізовані інші методи нанесення.

В роботі показані температурні, вольт-амперні та спектральні характеристики ІТО плівок, отриманих методом магнетронного напилення.

Також в роботі представлена оптимізація параметрів розпилювальних магнетронних систем для збільшення їх ефективності, а також вплив іонної обробки на товщину на показники заломлення ІТО плівок.

Ключові слова: ІТО плівки, магнетронні напилювальні системи, методи газофазного осадження.

Abstract

The work contains 72 pages, 26 figures, 44 bibliographic titles.

In this paper, the application of ITO films by magnetron sputtering is considered. Other methods of drawing are also scattered and analyzed.

The work shows the temperature, volt-ampere and spectral characteristics of ITO films obtained by magnetron sputtering.

Also in this work, optimization of parameters of sputtering magnetron systems to improve their efficiency is presented, as well as the effect of ion treatment on the thickness on the refractive index of ITO films.

Key words: ITO films, magnetron sputtering systems, gas-phase deposition methods.